

経済的なオリジナルタイプ  
Z測定範囲:50mm  
X軸分解能は0.1μmと高分解能  
円弧補正

Economical type  
Z measuring range: 50mm  
X axis 0.1μm High resolution  
Circular correction

### スカラ量解析

多数の要素解析ができ、その要素から多くのスカラ量を求めることができます。特に要素解析のうち、点、線、円は複数のプロフィールデータから求めることができるので、対象形状の中間に凸部や凹部が存在する形状からでも解析することができます。

### ボールねじ解析

ボールねじ転動みぞの形状解析ができます。

- 転動みぞ接触部の左右半径、左右接触角、接触点間の長さなどの自動解析
- 設計円と重ね合わせて、偏差形状表示
- ねじ、ナットの重ね合わせ表示

### 非球面解析\*

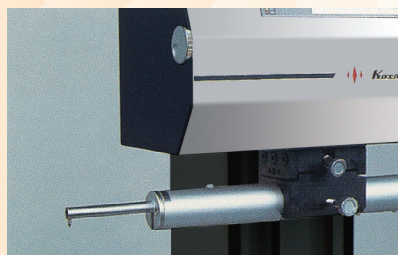
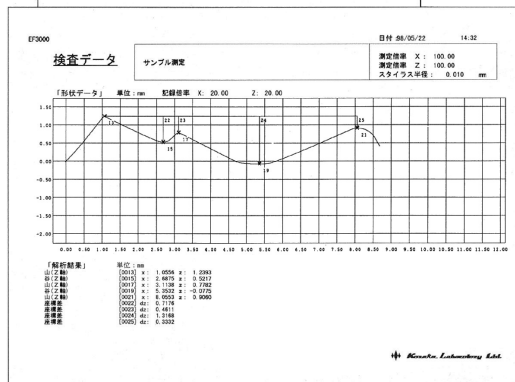
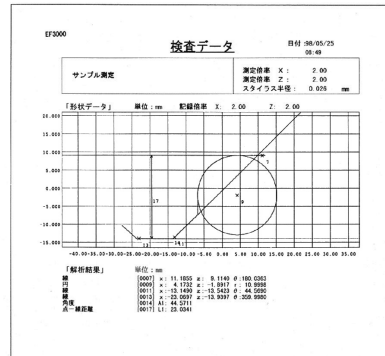
設計データを作成し、非球面測定データと照合して、偏差を形状、数値で表示します。

### マスタ比較\*

2データ（測定データあるいは設計形状データと対象物の形状データ）から、隙間、厚み、摩擦、変形、加工精度を偏差、輪郭度などで解析できます。

### 補正機能

測定値に重大な影響があるスタイラスの円弧運動補正、ZX直交補正が、直角プリズム形状校正ゲージを測定するだけで簡単に行える画期的な方式を採用しています。使用中スタイラスの先端半径が計測できるスタイラス検定ゲージと確認ソフトが付属しています。もちろん、この計測データにより、測定形状に含まれているスタイラス先端半径成分を的確に演算除去できます。



高倍率検出器  
High Magnification Pick Up  
PU-FH2



(コラム傾斜機構はオプション Column with tilting adjustment:Option)



## 仕様

型式	EF150E	EF150ED	EF3000
測定精度	X:±(1+0.02L)μm L=測定長さmm, Z:±0.25%/フルスケール		Z:±(1+ 0.04H )μm H=Z変位mm, X:±(1+0.02L)μm L=測定長さmm
分解能	X:0.1μm		Z:0.05μm, X:0.1μm サンプルング:Max250,000点 間隔0.5μm以上
測定範囲	Z:50mm X:100mm		Z:58mm X:100mm
記録倍率	Z,X:0.01~10,000倍		
測定項目・補助機能	要素:点、線、円、山、谷、交点、接点/スカラ量:座標差、距離、交角/ボールネジ解析、*非球面解析、*マスタ比較解析 パイプレータ、過負荷停止機能、マクロ機能、スタイラス曲率半径補正、つなぎ合わせ、ベストフィット機能、自由レイアウト印刷		
送り速度	0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2mm/s 高速移動速度 5、10mm/s、手動		
真直度測定精度	1μm/100mm		
追従角度	登り:7°(滑らかな面) 下り:87°		
検出器   標準用	スタイラス:R25μm 測定力:10~30mN(可変可能)		
検出器   高倍用(オプション)	測定力:4mN, スタイラス:R25/R10μm, 測定範囲:1.2mm		
検出器上下動	手動上下動	電動上下動	電動上下動
設置寸法・質量	W1500×D850mm 測定部:約80kg 演算部:約30kg		
電源	AC90~120V 550VA(パソコン、プリンタ用約300VA含む) 50/60Hz		

注意)\*印はEF150E/150EDの場合はオプションです。